

Biuletyn Informacji Publicznej

Adres artykułu: <https://bip.tu.kielce.pl/artukul/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-pracownikow-dydaktycznych-dyscyplina-inzynieria-mechaniczna>

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - dyscyplina inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka

DATA OGŁOSZENIA: 28.08.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2023r.

LINK DO STRONY: <https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/>

SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

dypłom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka, sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora, znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC, programowanie mikrokontrolerów z serii AVR, STM32, umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB, umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows, umiejętności obsługi programów stosowanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink, EPLAN, Mathcad znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, karty pomiarowe, znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka angielskiego zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

- doświadczenie w pracy w przemyśle,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,
- prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów,
- działalność promocyjna na rzecz uczelni.

Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
- życiorys (CV), kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,
- informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia **28.09.2023 r.** Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

[Informacja o wynikach konkursu](#)

Załączniki:

[Informacja o wynikach konkursu](#) pdf, 364 kB

Opublikował w BIP:	Miłosz PINDUR
Data opublikowania:	16.10.2023 14:10
Data ostatniej aktualizacji:	16.10.2023 14:10

Liczba pobrań:	30
-----------------------	----

Metryczka

Wytworzył:	Dziekan WMiBM dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk
Data wytworzenia:	28.08.2023
Opublikował w BIP:	Miłosz PINDUR
Data opublikowania:	28.08.2023 09:08
Ostatnio zaktualizował:	Ewa Karońska
Data ostatniej aktualizacji:	16.10.2024 11:48
Liczba wyświetleń:	42